Plasma display apparatus

Publication number: JP2003337568
Publication date: 2003-11-28

Inventor:
Applicant:
Classification:

- international: H04N5/66; G09G3/20; G09G3/28;

H04N5/66; G09G3/20; G09G3/28; (IPC1-7):

G09G3/28; G09G3/20; H04N5/66

- European: G09G3/28T; G09G3/288C6N

Application number: JP20020209950 20020718 Priority number(s): JP20020209950 20020718;

JP20020066960 20020312

Also published as:

图 EP1345199 (A2) 图 US6686698 (B2)

US2003173903 (A1

团 EP1345199 (A3) 团 EP1345199 (B1)

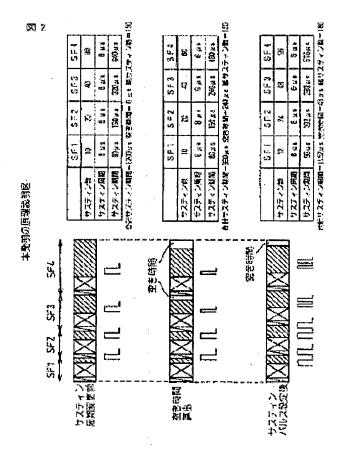
more >>

Report a data error hei

Abstract of **JP2003337568**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma display device in which deterioration in picture quality such as display defects or the like does not occur even though peak luminance is increased.

SOLUTION: The plasma display device conducts gray scale display using a subfield method. The device is provided with: a plasma display panel 11 which is provided with a plurality of scanning and sustain electrodes that are extended along the same direction and alternatively arranged adjacent to each other, and a plurality of address electrodes that are extended along the direction orthogonal to the plurality of the scanning and the sustain electrodes; sustain pulse period changing means 25 and 26 which detect a display load factor for every subfield and change the sustain pulse period for every subfield in accordance with the detected display load factor; and adaptive sustain pulse number changing means 27 and 28 which compute a total amount of variations in time that is obtained by summing the variations in time generated by changing the sustain pulse period within one display field, and



increase or decrease the number of sustain pulses in each subfield in accordance with the total amount of variations in time.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-337568 (P2003-337568A)

(43)公開日 平成15年11月28日(2003.11.28)

| (51) Int.Cl.7 | | 戲別記号 | | ΡI | | | Ť | -7]-ド(参考) |
|---------------|------|-------------|------|---------|--------|----|----------|-----------|
| G 0 9 G | 3/28 | | | C 0 9 G | 3/20 | | 612U | 5 C O 5 8 |
| | 3/20 | 6 1 2 | | | | | 624N | 5 C 0 8 0 |
| | | 624 | | | | | 641E | |
| | | 641 | | | | | 642C | |
| | | 6 4 2 | | H04N | T 5/66 | | "1.01B | |
| | | | 審査請求 | 未請求 請 | 求項の数10 | OL | (全 13 頁) | 最終頁に続く |
| | | | | | | | | |

(21)出廣番号 特願2002-209950(P2002-209950)

(22) 出顧日 平成14年7月18日(2002.7.18)

(31)優先権主張番号 特願2002-66960(P2002-66960) (32) 優先日 平成14年3月12日(2002.3.12)

(33)優先権主張国 日本 (JP) (71)出願人 599132708

富士通!]立プラズマディスプレイ株式会社

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号

(72)発明者 竹内 正憲

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 富士通日立プラズマディスプレイ株式会

社内

(74)代理人 10007/517

弁理士 石田 敬 (外4名)

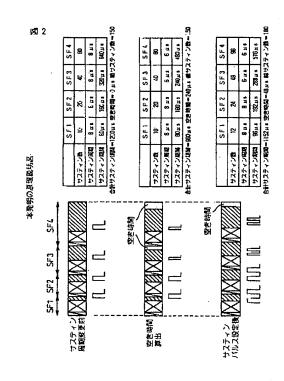
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイ装置

(57)【要約】

【課題】 ピーク輝度を高くしても表示欠点などの画質 低下が発生しないプラズマディスプレイ装置の実現。

【解決手段】 サブフィールド法を用いて階調表示を行 うプラズマディスプレイ装置であって、同じ方向に伸 び、隣接して交互に配置された複数の走査電極及び維持 電極と、複数の走査電極及び維持電極に直交する方向に 伸びる複数のアドレス電極とを備えるプラズマディスプ レイパネル11と、サブフィールドごとの表示負荷率を検 出し、検出した表示負荷率に応じてサブフィールド毎の サスティンパルス周期を変更するサスティンパルス周期 変更手段25,26と、サスティンパルス周期を変更するこ とにより生じた変動時間を1表示フィールド内で合計し た全変動時間合計値を算出し、全変動時間合計値に応じ て各サブフィールドのサスティンパルス数を増減する適 応的サスティンパルス数変更手段27,28とを備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 サブフィールド法を用いて階調表示を行うプラズマディスプレイ装置であって、

同じ方向に伸び、互いに隣接して配置された複数の走査 電極及び維持電極と、前記複数の走査電極及び維持電極 に直交する方向に伸びる複数のアドレス電極とを備える プラズマディスプレイパネルと、

サブフィールドごとの表示負荷率を検出し、検出した表 示負荷率に応じてサブフィールド毎のサスティンパルス 周期を変更するサスティンパルス周期変更手段と、

サスティンパルス周期を変更することにより生じた変動時間を1表示フィールド内で合計した全変動時間合計値を算出し、全変動時間合計値に応じて各サブフィールドのサスティンパルス数を増減する適応的サスティンパルス数変更手段と、を備えることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。

【請求項2】 前記適応的サスティンパルス数変更手段は、各サブフィールドの輝度比を維持するようにサスティンパルス数を増減する請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項3】 各サブフィールドのサスティンパルス周期を変更することによる輝度変化を補正する適応的輝度補正手段を更に備え、

前記適応的サスティンパルス数変更手段は、前記適応的 輝度補正手段の補正結果に応じて各サブフィールドのサ スティンパルス数を増減する請求項1に記載のプラズマ ディスプレイ装置。

【請求項4】 前記適応的サスティンパルス数変更手段は、各サブフィールドの表示負荷率に応じて各サブフィールドのサスティンパルス数を増減する請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項5】 前記サスティンパルス周期変更手段は、サブフィールド毎に表示負荷率が所定の値より小さい時には当該サブフィールドのサスティンパルス周期を短縮し、前記所定の値より大きい時には拡大する請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項6】 前記サスティンパルス周期変更手段は、最大輝度のサブフィールドを含む一部又はすべてのサブフィールドのサスティンパルス周期を変更する請求項1 に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項7】 前記サスティンパルス周期変更手段は、変更開始時のサスティンパルス周期から目標とするサスティンパルス周期までの変更を、複数フィールドで段階的に行う請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項8】 前記適応的サスティンパルス数変更手段は、サスティンパルス周期の変更に伴うサスティンパルス別の変更を、複数フィールドで段階的に行う請求項1 に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項9】 前記サスティンパルス周期変更手段は、 すべてのサブフィールド又は所定の輝度比以上のサブフ ィールドの表示負荷率が所定の値より小さい時には、すべてのサブフィールドのサスティンパルス周期を同一周期に変更する請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【請求項10】 前記適応的サスティンパルス数変更手段は、最大輝度のサブフィールドを含む一部又はすべてのサブフィールドのサスティンパルス数を変更する請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、サブフィールド法 により階調表示を行うプラズマディスプレイ装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】平面ディスプレイとしてプラズマディス プレイ装置 (PDP装置) が実用化されており、高輝度 の薄型ディスプレイとして期待されている。PDP装置 では、各表示セルを点灯するか点灯しないかの制御が行 えるだけであるので、PDP装置で階調表示を行う場合 には、1表示フィールドを複数のサブフィールドで構成 し、各セル毎に点灯するサブフィールドを組み合わせて 表示を行う。各サブフィールドは、少なくとも表示セル を選択するアドレス期間と、選択したセルを点灯するサ スティン期間を有する。サスティン期間にはサスティン パルスが印加されてサスティン放電が発生し、サスティ ンパルスの個数で輝度が決定される。サスティンパルス の周期が同一であれば、サスティン期間の長さで輝度が 決定されることになる。もっとも一般的で効率のよいサ ブフィールド構成は、各サブフィールドのサスティン期 間の長さ、すなわち輝度比を2の累乗とするものである が、近年は偽輪郭などを低減するために各種のサブフィ ールド構成が提案されている。本発明はどのようなサブ フィールド構成で表示を行うPDP装置にも適用可能で ある。

【0003】また、PDP装置には各種の方式が提案されており、本発明はどのような方式のPDP装置にも適用可能である。PDP装置の構成や駆動方法については広く知られているので、ここでは詳しい説明は省略する。

【0004】PDP装置では、全画面中の点灯するセルの割合(表示負荷率)が大きいと大きなサスティン電流が流れることになりサスティンパルスの実効電圧が低下して輝度が低下する。サブフィールド法で階調表示を行う場合、サブフィールド毎の表示負荷率が異なるために各サブフィールドの輝度比が所定の関係からずれて正常な階調表示が行えないという問題を生じる。特開平9-185343号公報は、このような問題を解決するため、各サブフィールドの表示負荷率を検出して輝度比を維持するように各サブフィールドのサスティンパルス数を補正する構成を開示している。

【0005】PDP装置の問題点として、ブラウン管に比べてピーク輝度が劣ることと、消費電力が大きいことが挙げられる。そのため、映像全体の輝度が高い時には各サブフィールドのサスティンパルス数を減少させて全体的に低輝度の映像を表示し、映像全体の輝度が低い時には各サブフィールドのサスティンパルス数を増加させて一部分は高輝度の映像を表示する電力制御が行われている。特開2000-322025号公報は、このような電力制御の1つの方法として、1画面全体の平均的な輝度レベルを検出して、輝度レベルが所定値未満の時にはサスティンパルス周期を短くすることを開示している。これにより、全体的に暗い映像の時にはピーク輝度が向上する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】サスティンパルス周期 を短くした場合、サスティンパルスの波形の鈍りの影響 が相対的に大きくなり、所定のサスティン電圧が印加さ れない場合が起きる。特に、表示負荷率が大きくなると サスティン電流が増加し、その分電圧降下が発生して実 際に印加される実効電圧が低下する。図1は、サスティ ンパルス周期が 6μ S、 8μ S及び 10μ Sの場合に、 表示負荷率に対する所定の電圧のサスティンパルスを印 加した時の実効サスティン電圧の関係を示した図であ る。実効サスティン電圧が低下するとサスティン放電が 発生しなかったり途中で停止して欠点が発生したり、正 常な輝度での発光が行われないなどの問題を生じる。特 開2000-322025号公報に開示された構成で は、輝度レベルが低い時、すなわち表示負荷率が小さい 時にはサスティンパルス周期を短くしており、図1の破 線Aで示したような制御を行っていることになる。

【0007】しかし、サブフィールド法により階調表現を行う場合に実際に問題になるのは各サブフィールドにおける表示負荷率である。例えば、輝度比の大きなサブフィールドの表示負荷率は非常に小さいが、輝度比の小さなサブフィールドの表示負荷率は大きい場合、1画面全体の平均的な輝度レベル(表示負荷率)は小さくなり、特開2000-322025号公報によればサスティンパルス周期を短くすることになる。従って、輝度比の小さな表示負荷率は大きなサブフィールドでもサスティンパルス周期を短くすることになり、欠点が発生するなどの問題を生じる。

【0008】本発明は、このような問題を解決することを目的とし、ピーク輝度を高くしても表示欠点などの画質低下が発生しないPDP装置の実現を目的とする。 【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的を実現するため、本発明のPDP装置は、サブフィールド毎の表示負荷率を検出し、各サブフィールドの表示負荷率に応じてサスティンパルス周期を変化させる。しかし、各サブフィールドのサスティン期間が一定の場合、一部のサブフ

ィールドのサスティンパルス周期を変化させると、サブフィールドの輝度比が変化することになる。そこで、本発明では、適応的サスティンパルス数変更手段を設けて、サスティンパルス周期を変更することにより生じた変動時間を1表示フィールド内で合計した全変動時間合計値を算出し、全変動時間合計値に応じて各サブフィールドのサスティンパルス数を増減する。

【0010】図2は、本発明の原理を説明する図である。図示のように、1表示フィールドは4個のサブフィールドSFI-SF4で構成される。サスティンパルス周期を変更する前は、サスティンパルス周期はすべてのサブフィールドで8 μ Sであり、SF1-SF4のサスティン期間は80 μ S、 160μ S、 320μ S及び640 μ Sであり、SF1-SF4のサスティンパルス数は10、20、40及び80である。

【0011】SF3とSF4の表示負荷率が所定値未満 の場合、SF3とSF4のサスティンパルス周期を6μ Sに変更する。この場合、デューティ比が一定であれ ば、パルス幅も同様の比率で変化する。SF3とSF4 のサスティンパルス数を40及び80に維持すると、S F3とSF4でそれぞれ80µSと160µSの空き時 間が生じることになる。そこで、SF1とSF2のサス ティンパルス周期を8µS、SF3とSF4のサスティ ンパルス周期を6µSに維持した上で、SF1-SF4 のサスティンパルス数を、それぞれ12、24、48、 96とする。これにより、総サスティンパルス数は15 ○から180に増加してピーク輝度が向上し、しかも各 サブフィールドの輝度比は所定の関係に維持される。各 サブフィールドの輝度比を維持したまま各サブフィール ドのサスティンパルス数を増加させるには、96μS以 上の空き時間が必要であるが、図示の48 µ Sの空き時 間はこれに満たないため、空き時間となる。また、表示 負荷率の大きなSF1とSF2のサスティンパルス周期 は8µSのままであり欠点などは発生せず、SF3とS F4のサスティンパルス周期は6µSになるが、表示負 荷率が低いので同様に欠点などは発生しない。

【0012】なお、表示負荷率が所定の値より大きい時には逆にそのサブフィールドのサスティンパルス周期を拡大してサステイン放電を安定化することも可能である。特に、PDP装置では一般に消費電力制御を行っており、総発光パルス数が増加すると消費電力が大きくなり過ぎるため、総サスティンパルス数を減少させている。このような場合には、1フレーム内に空き時間が生じることになる。このような場合には、サスティンパルス周期を拡大してサスティン放電を安定化することが望ましい。従って、サスティンパルス周期変更手段は、サブフィールド毎に表示負荷率が所定の値より小さい時にはそのサブフィールドのサスティンパルス周期を短縮し、所定の値より大きい時には拡大する。周波数の変更は、すべてのサブフィールドを対象としてもよいが、最

大輝度のサブフィールドを含む一部のサブフィールドの みを対象としてもよい。

【0013】適応的サスティンパルス数変更手段は、各サブフィールドの輝度比を維持するようにサスティンパルス数を増減する。

【0014】更に、図1に示すように、サスティンパルス周期を変更すると実効サスティン電圧が変化して輝度が変化するので、適応的輝度補正手段を更に設けてサスティンパルス周期の変更に伴う輝度変化を補正し、適応的サスティンパルス数変更手段は、補正結果に応じて各サブフィールドのサスティンパルス数を増減することが望ましい。

【0015】更に、各サブフィールドの表示負荷率に応じて実効サスティン電圧が変化するのでその分を補正することが望ましく、適応的サスティンパルス数変更手段は、各サブフィールドのサスティンパルス数を増減する。

【0016】更に、サスティンパルス周期を変更する場合、大きく変化させると表示に大きな変化が生じるので、そのような変化が感知されないように、複数の表示フィールドに渡って段階的に変更することが望ましい。また、サスティンパルス周期の変更に伴いサスティンパルスを変更する場合も、複数の表示フィールドに渡って段階的に変更することが望ましい。

【0017】更に、すべてのサブフィールド又は所定の輝度比以上のサブフィールドの表示負荷率が所定の値より小さい時には、すべてのサブフィールド又は最大輝度のサブフィールドを含む一部のサブフィールドのサスティンパルス周期を同一周期に変更するようにすれば、制御が容易である。

[0018]

【発明の実施の形態】図3は、本発明の第1実施例のP DP装置の概略構成を示すブロック図である。図示のよ うに、このPDP装置は、プラズマディスプレイパネル 11と、パネル11のアドレス電極を駆動する信号を出 力するアドレス電極駆動回路12と、スキャン電極 (Y 電極)に順次印加するスキャンパルス及びリセットパル スとサスティンパルスを出力するスキャン電極駆動回路 13と、サスティン電極(X電極)に印加するリセット パルスとサスティンパルスを出力するサスティン電極駆 動回路14と、映像入力信号をデジタル信号に変換する と共にタイミング信号を発生するA/D変換回路21 と、ディザや誤差拡散などの処理により映像信号の階調 数を調整する表示階調調整回路22と、調整された映像 デジタル信号を展開して各セルを階調表示するための点 灯サブフィールドの組み合わせを決定する映像信号-S F対応付け回路23と、サブフィールド表示のための駆 動信号を発生するSF処理回路24とを有し、SF処理 回路24からアドレス電極駆動回路12とスキャン電極 駆動回路13とサスティン電極駆動回路14に駆動信号

が供給される。以上の構成は、従来技術のPDP装置と同じである。従って、駆動波形などの詳細についてはここでは説明を省略する。

【0019】第1実施例のPDP装置は、各サブフィールドの表示負荷率を検出するSF負荷率検出回路25と、検出した各サブフィールドの表示負荷率に応じて各サブフィールドのサスティンパルス周期を変更するサスティン周期変更回路26と、サスティンパルス周期が変更された時の空き時間の変動を算出する空き時間算出回路27と、算出された空き時間を各サブフィールドの輝度比とサスティンパルス周期との積に比例させて配分する空き時間再配分回路28と、配分された時間へのサスティンパルスの割り当てを、輝度の連続性を維持するように複数のフィールドに渡って増加又は減少させることにより行なう表示階調補正回路29とを有する。空き時間算出回路27と空き時間再配分回路28が適応的サスティンパルス数変更手段に相当する。

【0020】図4は、映像信号と第1実施例における処理の関係を説明する図である。図示のように、1表示フィールドの先頭には垂直同期信号VINがあり、各表示フィールドの開始を検出する。垂直同期信号VINに続いて映像信号が入力される。各フィールドの映像信号の入力が開始されるまでの間に処理1が行われる。続いて各サブフィールドの開始に同期して処理2が行なわれ、各サブフィールドの駆動信号が生成されて表示が行なわれる。【0021】図5は処理1のフローチャートであり、図6は処理1内で行なわれる処理Aを示すフローチャートである。

【0022】ステップ101では、各サブフィールドS Fの表示負荷率SFL[]を計測する。ステップ102では、各サブフィールドの表示負荷率SFL[]に各サブフィールドの輝度比SFW[]を乗じたものをすべてのサブフィールドについて加算して加重平均負荷を算出する。ステップ101と102の処理はSF負荷率検出回路25が行なう。

【0023】ステップ103では、加重平均負荷が25%未満であるか判定し、25%以上の場合にはステップ105に進んで従来通りの処理を行い、25%未満の場合にはステップ104に進んで処理Aを行う。ステップ103と104の処理はサスティン周期変更回路26と空き時間算出回路27が行う。図6を参照して処理Aを説明する。

【0024】ステップ121では、 6μ Sのサスティンパルス数SUS6、 8μ Sのサスティンパルス数SUS8、空き時間TIMに初期値ゼロを、サブフィールド数 nに初期値1を入れる。ステップ122では、ステップ101で計測した各サブフィールドの表示負荷率SFL [n]が25%未満の場合にはステップ126に進む。

【0025】ステップ123では、サスティンパルス周期を示すSFT[n]に 6μ Sであることを示す1を入れる。ステップ124では、SUS6をそのサブフィールドのサスティンパルス数SFP[n]だけ増加させる。サスティンパルス周期の 8μ Sから 6μ Sへの変更に伴い空き時間SFP[n]× 2μ Sが生じるので、ステップ125でTIMをその分だけ増加させる。その後ステップ128に進む。

【0026】一方、ステップ126では、サスティンパルス周期を示すSFT [n] に 8μ Sであることを示す0を入れる。ステップ127では、SUS8をそのサブフィールドのサスティンパルス数SFP [n] だけ増加させる。この場合は空き時間は生じないので、ステップ128に進む。

【0027】ステップ128ではサブフィールド数 nを 1だけ増加させ、ステップ129ですべてのサブフィールドについてステップ122から128の処理が終了したか判定し、終了していなければステップ122に戻り、終了していればステップ130に進む。

【0028】ステップ130と131では、図の式に従って、空き時間TIMを8μSのサスティンパルス数SUS8と6μSのサスティンパルス数SUS8の比率で割り振り、それからSUS8とSUS6の増加分を算出して最終的な8μSのサスティンパルス数SUS8と6μSのサスティンパルス数SUS8を求める。ステップ132では、SUS8とSUS6を加算して総サスティンパルス数SUSを求める。この後、図5のステップ105に戻る。

【0029】ステップ105では、ステップ132で求めたSUSを総サスティンパルス数として決定する。ステップ106では、総サスティンパルス数SUSを各サブフィールドに配分して各サブフィールドのサスティンパルス数SFP[]を求める。ステップ106の処理は、空き時間再配分回路28が行う。

【0030】そして、ステップ107では、各サブフィールドの表示負荷率に応じて電圧降下のために輝度が低下するので、その分の補正を行う。この際、サスティンパルス周期の変更に伴う実効電圧の変化による輝度変動も合わせて補正する。ステップ108では、サスティンパルス数を変更する場合、複数のフィールドに渡って段階的に変更するように調整する。例えば、総サスティンパルス数を150から180に増加させる場合、次のフィールドでは総サスティンパルス数を160に、その次のフィールドでは総サスティンパルス数を170に、そして次のフィールドでは総サスティンパルス数を170に、そして次のフィールドでは総サスティンパルス数を180にすると言う具合に3フィールドに渡って段階的に変更する。ステップ107と108の処理は、表示階調補正回路29が行う。

【0031】ステップ109では表示するサブフィールドを示す符号mに初期値1を入れて処理1は終了する。

【0032】図7は、処理2を示すフローチャートである。

【 0033】ステップ 151では、サスティンパルス周期を示すSFT [m]の値を判定し、1であれば 6μ Sであるのでステップ 152に進み、0であれば 8μ Sであるのでステップ 152ではサスティンパルス周期を 6μ Sに設定し、ステップ 153ではサスティンパルス周期を 8μ Sに設定する。

【0034】ステップ154では、ステップ106で求めてステップ107と108で調整したそのサブフィールドのサスティンパルスSFP[m]を読み出して、印加するサスティンパルス数を制御する部分に設定する。ステップ155では、mを1増加させて終了する。

【0035】処理2は、前述のように各サブフィールドに同期して行なわれる。

【0036】第1実施例では、サスティンパルス周期を 8μ Sと 6μ Sの2段階のみとしたが、それ以上の段階を設けることも可能であり、例えば、通常は 8μ Sとし、表示負荷率が小さい場合には 6μ Sに変更し、表示負荷率が大きい場合には 10μ Sに変更するようにしてもよい。

【0037】また、第1実施例では、サスティンパルス 周期を8 μ Sから6 μ Sに変更させ、総サスティンパルス 数の増加を段階的に行なうように調整したが、それまでの8 μ Sから目標とする6 μ Sに変更する場合、次のフィールドでは7.5 μ Sに、その次のフィールドでは7.0 μ Sに、更に次のフィールドでは6.5 μ Sに、そして次のフィールドでは6.0 μ Sにするという具合に複数のフィールドに渡って段階的にサスティンパルス 周期を変更するようにしてもよい。

【0038】更に、第1実施例では、全サブフィールドのサスティンパルス周期を表示負荷率に応じて変更する対象としたが、輝度比の高いサブフィールドでサスティンパルス周期を小さくする方が大きな空き時間が発生するので、サスティンパルス周期の変更対象を最大輝度のサブフィールドを含む所定の輝度比以上のサブフィールドに限定してもよい。この場合、空き時間によるサスティンパルス数の増加分は全サブフィールドに再配分しても、最大輝度のサブフィールドを含む所定の輝度比以上のサブフィールドに限定して再配分してもよい。サスティンパルス周期の変更対象をこのように限定することにより、演算量を低減できる。

【0039】更に、第1実施例では、各サブフィールドの表示負荷率をそれぞれ判定して小さい場合に各サブフィールドのサスティンパルス周期とサスティンパルス数を算出した上で全体の総サスティンパルス数を算出したが、最初に全サブフィールドの表示負荷率を判定してすべて所定の値より小さければ、全サブフィールドのサスティンパルス周期を小さくするようにしてもよい。これであれば、単に各サブフィールドのサスティンパルス数

に変更前後のサスティンパルス周期の比を乗ずればよい ので演算が容易である。なお、この場合も、サスティン パルス周期の変更対象を最大輝度のサブフィールドを含 む所定の輝度比以上のサブフィールドに限定すれば、演 算量が更に削減できる。

【0040】図8は、本発明の第2実施例のPDP装置の概略構成を示すブロック図である。図3と比較して明らかなように、第1実施例のPDP装置と異なるのは、パネル表面温度検出回路31とサスティンパルス数設定回路32が追加されている点である。サスティンパルス数を増加することにより、パネル11の点灯している領域の温度が上昇し、点灯領域と非点灯領域の温度差が大きくなるとパネル11が破損する場合が起こり得る。第2実施例では、これを防ぐために、パネル表面温度検出回路31が温度上昇を監視し、ある一定以上の上昇を検出した時には、サスティンパルス数設定回路32がサスティンパルス数の増加を抑制して温度上昇を小さくている。

【0041】図9は、本発明の第3実施例のPDP装置の概略構成を示すブロック図である。図8と比較して明らかなように、第2実施例のPDP装置と異なるのは、静止画検出回路33が追加されている点である。パネル温度上昇によるパネルの破損は、点灯部と非点灯部の温度差が原因である。動画の時には点灯部と非点灯部が固定されないので部分的な温度差は生じにくく、静止画の時に部分的な温度差が生じやすい。そこで、第3実施例のPDP装置では、静止画検出回路33が静止画であることを検出するとそれをサスティンパルス数設定回路32に通知する。サスティンパルス数設定回路32に通知する。サスティンパルス数設定回路32に通知する。

【0042】以上説明した第1から第3実施例では、サスティンパルス周期を短縮してサスティンパルス数を増加させる例を説明したが、表示負荷率が大きい時には逆にサスティンパルス周期を拡大して安定的に放電を行わせるのが望ましい場合もある。次に説明する第4実施例は、あるサブフィールドではサスティンパルス周期を短縮し、あるサブフィールドではサスティンパルス周期を短拡大する例である。

【0043】本発明の第4実施例のPDP装置は、図3に示した第1実施例のPDP装置と同様の構成を有し、図4で示したのと同様に処理が行われ、その処理内容が異なる。

【0044】図10は、第4実施例における処理1のフローチャートである。

【0045】図10に示すように、第4実施例の処理1では、第1実施例の処理1のステップ102までと同じ処理が行われる。次に、ステップ201では、算出した加重平均負荷から、消費電力を考慮して総サステインパルス数TSUS0を一旦決定する。ステップ202で

は、総サステインパルス数TSUSOからサブフィールドの輝度比に従って各サブフィールドのサステインパルス数SFP[]を算出する。

【0046】次に、ステップ203で、各サブフィールドのサステイン周期を変更する処理Bを行う。後のステップ204から208の処理は、第1実施例のステップ105から109の処理と同じである。

【0047】図11は処理1内で行なわれる処理Bを示すフローチャートである。処理Bにおいては、ステップ211で、n、各SFのサステイン周期SFT[]、空き時間TIMを初期化してゼロにする。ステップ212で、図11に示したテーブルから各SFの負荷率SFL[n]に対応する各SFのサステイン周期SFT

[n]を一旦決定する。なおこのテーブルはサステイン 周期変更回路26に設けられている。更にステップ21 3と214を行うことにより、このような処理をすべて のSFについて行なうように繰り返す。

【0048】ステップ215では、上記のようにして決定した各SFのサステイン周期SFT[] に各SFのサステインパルス数SFP[]を乗して1フィールド内のサステイン期間の合計時間STIM1を算出する。ステップ216では、STIM1が1フィールド内のサステイン期間の合計時間の最大値STIM0を越えているか判定する。越えていなければ総サステインパルス数を増加させる余地があるので、ステップ217で総サステインパルス数を増加させる必要があるので、ステップ218で総サステインパルス数を減少させる必要があるので、ステップ218で総サステインパルス数を減少させる必要があるので、ステップ218で総サステインパルス数を減少させる処理Dを行う。

【0049】上記のテーブルには、負荷率に応じた望ましいサステイン周期が記載されており、負荷率が小さければサステイン周期は短く、負荷率が大きくなるに従ってサステイン周期を長くする。

【0050】図12は、処理Cを示すフローチャートである。ステップ221で、空き時間TIMに上記のSTIMOとSTIM1の差STMO-STM1を代入する。次に、ステップ222で、第1のサブフィールドSF[1]を基準として、各SFの輝度比に各SFのサステイン周期SFT[]を乗じて加算し、サステイン周波数を変更する場合の単位時間UNIT Tを算出する。ステップ223では、各SFの輝度比SFW[n]を第1のサブフィールドの輝度比SFW[1]で除して加算し、サステイン周波数を変更する場合の単位サステインパルス数UNIT Nを算出する。

【0051】SF[1]で1個のサステインパルスを増加させる場合、輝度比を維持するにはSF[2]で2個のサステインパルスを増加させるという具合に、各SFで輝度比に対応するサステインパルス数を増加させる必要がある。従って、SF[1]で1個のサステインパルスを増加させる場合、輝度比を維持するには、フレーム

全体ではUNIT Nだけサステインパルス数を増加させる必要がある。すなわち、UNIT Nはサステインパルス数を変更する場合の単位数である。また、その場合、フレーム全体ではUNIT Tだけサステイン時間を増加させる必要がある。すなわち、UNIT Tは、1フィールドで輝度比を維持しながらそれに対応してサステインパルスを増加させるのに必要な単位時間を示す。

【0052】ステップ224では、空き時間TIMをUNIT_Tで除して、何単位時間増加可能であるかを算出する。この場合、小数点以下は切り捨てる。そして、算出結果にUNIT Nを乗じて増加させるサステインパルス数SUSを算出する。ステップ225では、図10のステップ201で算出したTSUS0にSUSを加算して増加後のサステインパルス数TSUSを算出する。

【0053】以上のようにして、総サステインパルス数が増加される。

【0054】図13は、処理Dを示すフローチャートである。図12と比較して明らかなように、処理Cとは、ステップ225の替わりにステップ226が行われる点が異なるだけで、他は同じである。ステップ226では、サステインパルス数を減少させるので、TSUS0からSUSを減算する。

【0055】図14は、第4実施例で行う処理2を示す フローチャートある。ステップ231では、各(m番目 の) サブフィールド毎にサステインパルス駆動周期SF T[m]を設定する。ステップ232では、各サブフィ ールドの出力サステインパルス数SFP[m]を設定す る。このようにして設定されたSFT[m]及びSFP [m] に従ってm番目のサブフィールドのサステイン動 作を行う。そして、ステップ233でmの値を1だけ増 加させて、ステップ231から232を繰り返して次の m+1番目のサブフィールドのサステイン動作を行う。 【0056】図15は、第4実施例での処理の結果の例 を示す図であり、図2に対応する。図示のように、サス テイン周期を変更する前には、SF1-SF4のサステ イン周期はすべて8µsであり、SF1-SF4のサス テイン期間の合計は1200µsであり、総サステイン パルス数は150である。ここで、SF1とSF2は負 荷率が大きいためにサステイン周期を長くする必要があ るが、SF3とSF4は負荷率が小さいためにサステイ ン周期を長くする必要はなく、逆に短くできるとする。 【0057】このような場合に第4実施例の処理を適用 した場合を説明する。SF1とSF2ではサステイン周 期を10µsに拡大し、SF3とSF4はサステイン周 期を6µsに短縮すると仮定する。このため、SF1の サステイン期間は80μsから100μsに20μs増 加し、SF2のサステイン期間は160μsから200 μsに40μs増加し、増加し、SF3のサステイン期 間は $80\mu s$ 減少し、SF4のサステイン期間は $160\mu s$ 減少し、フレーム全体ではサステイン期間が $180\mu s$ 減少し、空き時間を生じる。

【0058】SF1のサステイン数を1増加させるとそれに応じてSF2からSF4のサステイン数を2、4、8増加させる必要があり、それに要する単位時間は $1 \times 10 \mu s + 2 \times 10 \mu s + 4 \times 6 \mu s + 8 \times 6 \mu s = 1$ 02 μs である。上記のように空き時間は $180 \mu s$ であるのでサステインパルスを1単位だけ増加させることが可能であり、SF1からSF4のサステインパルス数は11、22、44、88となり、空き時間は $78 \mu s$ である。従って、元の状態に比べてサステインパルス数を10%増加させて、しかも各サブフィールドのサステイン周期をより適切にできるので、表示欠点などの画質低下が発生しない。なお、この例ではサステイン周期を $8 \mu s$ から $6 \mu s$ 又は $10 \mu s$ に変更したが、図11に示すようなテーブルを使用してより適切な周期に変更することももちろん可能である。

【0059】以上のように、第1実施例では一部のサブフィールドではサステイン周期を短縮し、他のサブフィールドではサステイン周期を維持する場合を、第4実施例では、一部のサブフィールドではサステイン周期を短縮し、他のサブフィールドではサステイン周期を拡大する場合を示したが、一部又はすべてのサブフィールドではサステイン周期を拡大し、他のサブフィールドではサステイン周期を維持することも可能である。これは、例えば電力制御により総サステインパルス数が減少するように制御されて空き時間が生じた場合などに有効である。

[0060]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ピーク輝度を高くしても表示欠点などの画質低下が発生 しないPDP装置が実現される。

【図面の簡単な説明】

【図1】サスティンパルス周期に応じた表示負荷率と実効サスティン電圧の関係を説明する図である。

【図2】本発明の原理を説明する図である。

【図3】本発明の第1実施例のPDP装置の概略構成を示すブロック図である。

【図4】第1実施例における処理を説明する図である。

【図5】第1実施例における処理を示すフローチャート である。

【図6】第1実施例における処理を示すフローチャート である

【図7】第1実施例における処理を示すフローチャート である。

【図8】本発明の第2実施例のPDP装置の概略構成を 示すブロック図である。

【図9】本発明の第3実施例のPDP装置の概略構成を示すブロック図である。

【図10】第4実施例における処理を示すフローチャー トである。

【図11】第4実施例における処理を示すフローチャー トである。

【図12】第4実施例における処理を示すフローチャー トである。

【図13】第4実施例における処理を示すフローチャー トである。

【図14】第4実施例における処理を示すフローチャー トである。

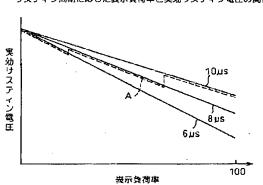
【図15】第4実施例の処理を適用した処理結果の例を 示す図である。

【符号の説明】

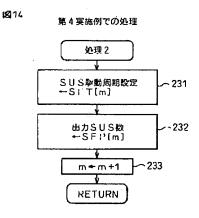
- 11…プラズマディスプレイパネル
- 12…アドレス電極駆動回路
- 13…スキャン電極駆動回路
- 14…サスティン電極駆動回路
- 24…SF処理回路
- 25…SF負荷率検出回路
- 26…サスティン周期変更回路
- 27…空き時間算出回路
- 28…空き時間再配分回路
- 29…表示階調補正回路

【図1】

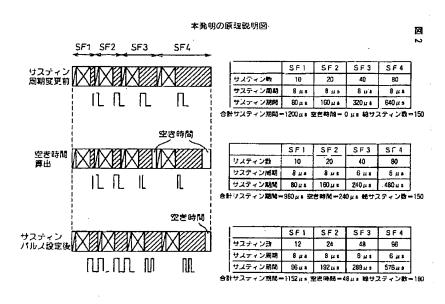
図 1 サスティン周期に応じた表示負荷率と実効サスティン電圧の関係



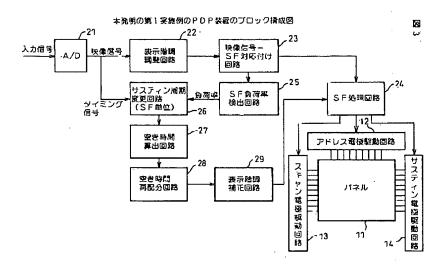
【図14】



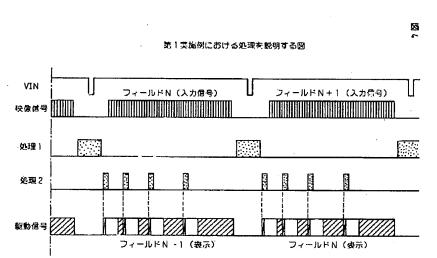
【図2】



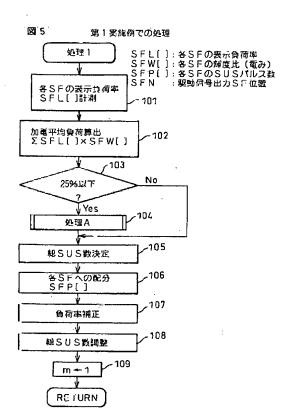
【図3】



【図4】

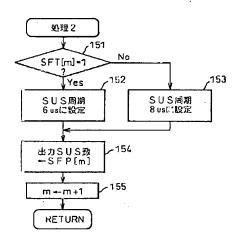


【図5】

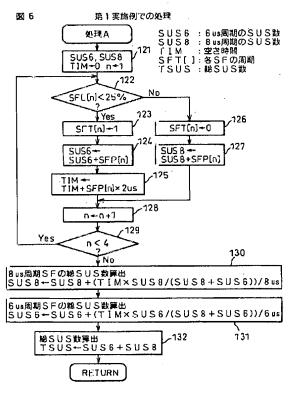


【図7】

図7 第1実施例での処理

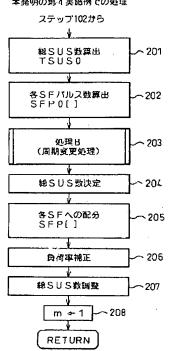


【図6】

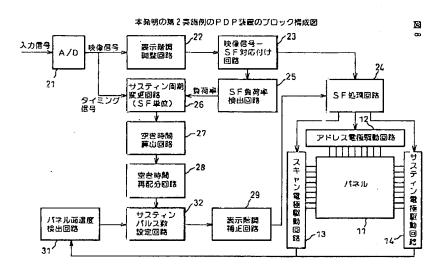


【図10】

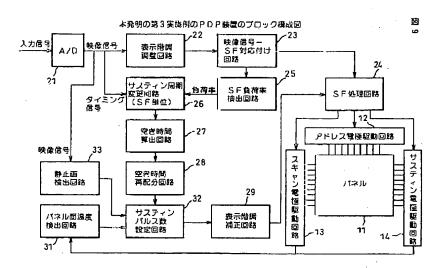
図10 本発明の第4実施例での処理



【図8】

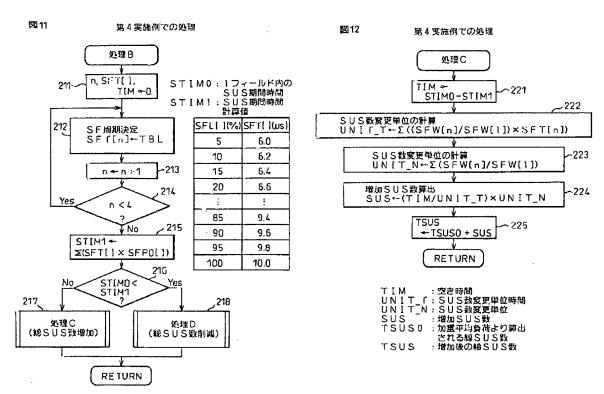


【図9】

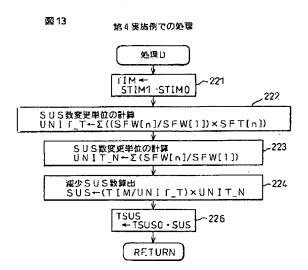


【図11】

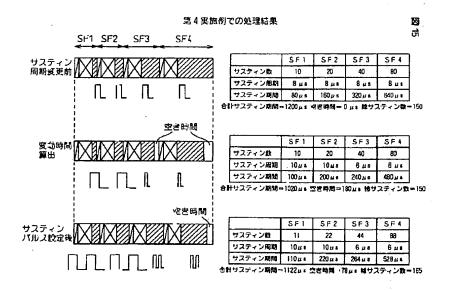
【図12】



【図13】



【図15】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

H O 4 N 5/66

101

FΙ

G09G 3/28 (参考)

K Η

(72)発明者 上田 壽男

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 富士通日立プラズマディスプレイ株式会

社内

(72) 発明者 浅生 重晴

神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 富士通日立プラズマディスプレイ株式会 社内

Fターム(参考) 5C058 AA11 BA04 BA05 BA07 BB03

5C080 AA05 BB05 DD04 DD26 EE29 HH04 HH05 JJ02 JJ04 JJ06 JJ07